

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2020-38092  
(P2020-38092A)

(43) 公開日 令和2年3月12日(2020.3.12)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
GO 1 N 15/02 (2006.01)	GO 1 N 15/02 E	2 G O 5 7
GO 1 N 21/3581 (2014.01)	GO 1 N 21/3581	2 G O 5 9
GO 1 N 21/05 (2006.01)	GO 1 N 21/05	

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 26 頁)

(21) 出願番号	特願2018-164654 (P2018-164654)	(71) 出願人	598015084 学校法人福岡大学 福岡県福岡市城南区七隈8丁目19番1号
(22) 出願日	平成30年9月3日(2018.9.3)	(71) 出願人	000006231 株式会社村田製作所 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号
		(74) 代理人	100145403 弁理士 山尾 憲人
		(74) 代理人	100132241 弁理士 岡部 博史
		(74) 代理人	100113170 弁理士 稲葉 和久
		(72) 発明者	瀬戸 弘一 福岡県福岡市城南区七隈8丁目19番1号 学校法人福岡大学内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 粒度分布測定装置、及び、粒度分布測定用流路ユニット

(57) 【要約】

【課題】従来の方法によらない粒度分布測定装置を提供する。

【解決手段】粒度分布測定装置は、被測定物を含む流体を上流側から下流側に流通させる流路と、金属製薄膜に第1の開口径を有する同形状の貫通孔を周期的に2次元配置した第1空隙配置構造体と、下流側に、金属製薄膜に第1の開口径より小さい第2の開口径を有する同形状の貫通孔を周期的に2次元配置した第2空隙配置構造体と、第1及び第2空隙配置構造体を貫く電磁波を照射する光源と、第1及び第2空隙配置構造体を透過した電磁波を検出する検出器と、第1空隙配置構造体を透過した電磁波の透過率から、第1空隙配置構造体を透過した電磁波の透過率と捕捉量との関係を示す第1の検量線に基づいて、第1空隙配置構造体に捕捉量を算出すると共に、第2空隙配置構造体を透過した電磁波の透過率から、第2空隙配置構造体を透過した電磁波の透過率と捕捉量との関係を示す第2の検量線に基づいて第2空隙配置構造体に捕捉量を算出する、捕捉量算出部と、を備える。

【選択図】 図9

図9

